

---

## 工艺实验设备

原值 500 万以上的对外提供共享服务的大型科学仪器设备总量为 535 台（套），其中工艺实验设备的数量为 88 台（套），占总量的 16.4%。工艺实验设备中，电子工艺实验设备 53 台（套），加工工艺实验设备 15 台（套），化工、制药工艺实验设备 11 台（套），汽车工艺实验设备 7 台（套），其他 2 台（套）。



工艺实验设备/88台(套)

序号	中文名称	型号规格	产地	单位名称	所在地
1	轧机系统	按照设备需要	中国	重庆市科学技术研究院	重庆
2	真空自耗电弧熔炼炉	L360P1	德国	西北有色金属研究院	陕西
3	高温烧结炉	1300-2036-WW	美国	西北有色金属研究院	陕西
4	电子束熔炼炉	2/50/500	德国	西北有色金属研究院	陕西
5	挤压机	16.3MN	中国	西北有色金属研究院	陕西
6	电子束曝光机	2013066	美国	国家纳米科学中心	北京
7	高压单晶生长系统	MR2550	英国	中国科学院半导体研究所	北京
8	金属有机物气相外延系统	D125	美国	中国科学院半导体研究所	北京
9	金属有机物气相淀积系统	3X2GaN	英国	中国科学院半导体研究所	北京
10	分子束外延	EPI-Gen-II	美国	中国科学院半导体研究所	北京
11	分子束外延设备	Veeco GEN II	美国	中国科学院半导体研究所	北京
12	分子束外延系统	MODULAR GEN II 型	美国	中国科学院半导体研究所	北京
13	8片MOCVD外延生长系统(8片)	AIX24000G3 IC	中国	中国科学院半导体研究所	北京
14	电子束曝光系统	Raith150-Turnkey	德国	中国科学院半导体研究所	北京
15	金属有机化学汽相淀积系统	p125	美国	中国科学院半导体研究所	北京
16	分子束外延系统	VG80	英国	中国科学院半导体研究所	北京
17	分子束外延系统	Riber 32P	法国	中国科学院半导体研究所	北京
18	分子束外延设备及镓炉和氮炉	EPI	美国	中国科学院半导体研究所	北京
19	离子束溅射系统	Optofab3000	英国	中国科学院半导体研究所	北京
20	5t/d循环流化床双床煤气化试验台	自行研制	中国	中国科学院工程热物理研究所	北京
21	离子束光学抛光机	IBF450	德国	中国科学院光电技术研究所	四川
22	中瑞循环流化床装置	ETH-IPE CFB	瑞士	中国科学院过程工程研究所	北京
23	法国交流电动机组	WT-1207	法国	中国科学院合肥物质科学研究院	安徽
24	热等静压机	QIH-21	美国	中国科学院金属研究所	辽宁
25	真空感应炉	ZGW-1500	中国	中国科学院金属研究所	辽宁
26	TEER UDP650 真空系统	UDP650	英国	中国科学院兰州化学物理研究所	甘肃
27	复现高超声速飞行条件激波风洞	JF12	中国	中国科学院力学研究所	北京
28	超燃自幼射流风洞	2005-02-01	中国	中国科学院力学研究所	北京
29	JF10 炮轰驱动激波风洞	1970-04-11	中国	中国科学院力学研究所	北京
30	JF8A 激波风洞	研制	中国	中国科学院力学研究所	北京
31	低压化学气相沉积系统	DF550-4	法国	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	上海
32	超高真空化学气相淀积	ASM Epsilon 2000	新加坡	中国科学院微电子研究所	北京
33	超低能离子注入机	Varian VIISTA HCS	美国	中国科学院微电子研究所	北京
34	快速热退火系统	Applied Materials Centura	美国	中国科学院微电子研究所	北京
35	等离子氮化系统	Applied Materials Centura	美国	中国科学院微电子研究所	北京
36	金属栅溅射台	INFOVION IS-6330	韩国	中国科学院微电子研究所	北京
37	等离子化学增强气相淀积	Applied Materials Producer 200mm	美国	中国科学院微电子研究所	北京
38	硅化物热退火系统	Applied Materials Radiance	美国	中国科学院微电子研究所	北京
39	刻蚀机(反应离子)	R/B 4520	美国	中国科学院微电子研究所	北京

工艺实验设备/88台(套)

序号	中文名称	型号规格	产地	单位名称	所在地
40	光刻机(电源柜、电脑控制系统)	PAS5000-55	荷兰	中国科学院微电子研究所	北京
41	刻蚀机(反应离子)	TCP9600	美国	中国科学院微电子研究所	北京
42	电子束光刻系统	JBX5000LS	日本	中国科学院微电子研究所	北京
43	接触与互连溅射台	Applied Materials Endura 200	美国	中国科学院微电子研究所	北京
44	金属栅刻蚀机	LAM A/94DFMx2	美国	中国科学院微电子研究所	北京
45	氧化硅/氮化硅刻蚀机	LAM A/EXHPTx2	美国	中国科学院微电子研究所	北京
46	钨化学气相淀积系统	Applied Materials Centura Isprit 200mm	美国	中国科学院微电子研究所	北京
47	电子束曝光系统	JEOL JBX-6300FS	日本	中国科学院微电子研究所	北京
48	电子束曝光系统	Raith150	德国	中国科学院物理研究所	北京
49	高电压电子束曝光设备	JBX-6300FS	日本	中国科学院物理研究所	北京
50	重型发动机排放测试系统	MEXA-7400D	日本	北京理工大学	北京
51	超音速风洞	*	中国	南京航空航天大学	江苏
52	数控加工中心	SAJO12000P	瑞典	西北工业大学	陕西
53	高超声速静风洞	*	中国	北京大学	北京
54	有机金属化学淀积系统	3X2" GaN	英国	北京大学	北京
55	2K低温系统	L140-2K	瑞士	北京大学	北京
56	电子束光刻机	nB3	英国	北京大学	北京
57	离子注入机	HV-400	荷兰	北京师范大学	北京
58	化学气相沉积系统	3*2 flip top ccs MOCVD	英国	大连理工大学	辽宁
59	物理气相沉积系统	Sunicel plus 200	韩国	电子科技大学	四川
60	退火模拟实验机	自制	中国	东北大学	辽宁
61	发动机性能开发实验台	PUMAOPEN	奥地利	湖南大学	湖南
62	柔性制造系统	Mandelli-M7V	意大利	华中科技大学	湖北
63	金属有机物化学气相沉积	CCS 3*2FT	英国	华中科技大学	湖北
64	光电子微纳制造工艺平台	CCS 3*2FT	英国	华中科技大学	湖北
65	氦液化设备	TCF10	瑞士	南京大学	江苏
66	电子束光刻机	e-LiNe	德国	南京大学	江苏
67	分子束外延系统	VARIANSH110 SPECS9*-9mbar	德国	山东大学	山东
68	离子注入机	HV-400	荷兰	北京市辐射中心	北京
69	发动机试验台	AVL AFA404	奥地利	同济大学	上海
70	发动机试验台	AVL AFA202	奥地利	同济大学	上海
71	发动机排放分析系统	AMA4000	德国	同济大学	上海
72	气动声学风洞风机系统	WA85.45/MV7000	德国	同济大学	上海
73	热环境风洞转鼓系统	非标	德国	同济大学	上海
74	紫外激光蓝宝石衬底剥离系统	IX-660	美国	西安交通大学	陕西
75	真空沉积炉应力测试系	*	德国	西安交通大学	陕西
76	电子束直写刻蚀系统	CABC9300CSX	日本	西安交通大学	陕西
77	超精密数控外圆磨床	*	瑞士	西安交通大学	陕西
78	数控铣床	H5-800	美国	西安交通大学	陕西

工艺实验设备/88 台（套）

序号	中文名称	型号规格	产地	单位名称	所在地
79	超高精度矿物材料磨抛加工机床	350FG	中国	浙江大学	浙江
80	磁控溅射仪	FSE-CLS-SP-100	中国台湾	中国科学院紫金山天文台	江苏
81	热模拟试验机	Gleeble System 3500	美国	北京工业大学	北京
82	热等静压机	D750*1200	中国	安泰科技股份有限公司	北京
83	热等静压机	φ 1250×2200	中国	安泰科技股份有限公司	北京
84	热等静压机	φ 850×2500	瑞典	安泰科技股份有限公司	北京
85	热等静压机	φ 400×900	中国	安泰科技股份有限公司	北京
86	汽车排放测试系统	AMA4000	德国	黑龙江工程学院	黑龙江
87	汽车 EMC 测试转鼓系统	RPL4×955 12C21M54 4×GPM225 1295	德国	上海机动车检测中心	上海
88	电子束光刻机	Raith Poineer	德国	苏州大学	江苏

